

装置管理システムマニュアル

Equipment System Manual

物質・材料研究機構

材料創製・評価プラットフォーム 電子顕微鏡ユニット

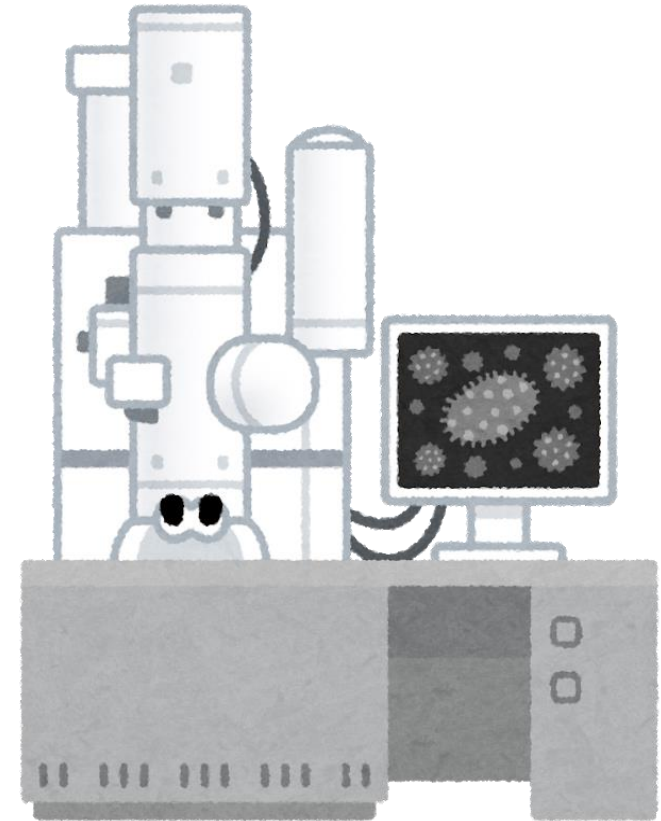
NIMS Materials Fabrication and Analysis Platform,

Electron Microscopy Unit

目次

Contents

- ユーザー登録(内部利用) 2
User Registration (Internal)
- 利用申請(内部利用) 4
Application for use (Internal)
- 装置の予約 10
Equipment Reservation
- 装置の予約(修正・取消) 14
Equipment Reservation (Revise and Cancel)
- 利用料金について 18
The Support Charge



ユーザー登録/User Registration

【URL】

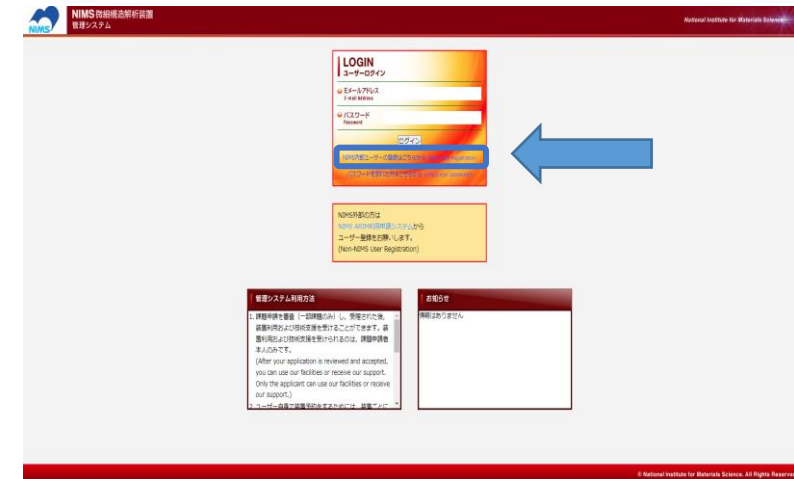
<https://www.nmcp.jp/>

「NIMS内部ユーザーの登録はこちらから」をクリックします。

ユーザー登録済みの方はメールアドレス(大文字・小文字を区別します)とパスワードでログイン。

Please click “NIMS User Registration”.

If you are a registered user, log in with your email address (case sensitive) and password.



ユーザー登録

NIMS 情報基盤解析装置 管理システムをご利用いただくためのユーザー登録フォームです。
必要事項をご記入の上、ご登録ください。
※は必須入力項目になります。

●暗号化について
Encryption
このサイトは、ブラウザとサーバー間での情報の送受信が暗号化されています。左記の画像をクリックして証明書の内容をご確認ください。

●職員番号
NIMS staff ID

●パスワード
Password
半角英数字3～16文字 (再入力)

●氏名
Name
[例] 千原 太郎
[Ex] Taro SENGEN

●氏名 (カナ)
Name (English)
[例] センゲン タロウ
[Ex] センゲン タロウ

●年齢層
Age
● 20代以下 (under 20s)
● 30代 (30s)
● 40代 (40s)
● 50代以上 (50s and more)

●ユーザー区分
User Classification
● 大企業 (Large enterprise) (従業員100人以上)
● 中小企業 (Small and medium-sized enterprise)
● 企業 (その他) (Company enterprise)
● 大学等 (University)
※NIMSジュニア研究員はNIMSを選択してください
※For NIMS Junior Researcher, please select "NIMS".
● 公的研究機関 (Public institution)
● NIMS (NIMS)

●所属機関
Affiliated Institution
[例] ○○大学, ○○株式会社
[Ex] XX University, XX Corporation

●所属部署
Affiliated Department
[例] 工学部○○学科, 大学院○○研究科○○専攻, ○○学生部
[Ex] XX Department, XX Division

●役職
Job Position
[例] 大学院生, 修士1年, ポスドク, 教授, 研究員
[Ex] Graduate Student, Postdoctoral Researcher, Professor, Researcher

●所属機関郵便番号
Office Zip Code
[例] 305-0047
[Ex] 305-0047

●所属機関住所
Office Address
[例] 茨城県つくば市千代1-2-1
[Ex] 1-2-1 Senjyu, Tsukuba, Ibaraki

●電話番号
Telephone number
[例] 029-859-2310
[Ex] 029-859-2310

●Eメールアドレス
E-mail Address
パソコンでメール発信できるアドレス
(E-mail address of your personal computer)

●居住者非居住者の別
Residential Status
すでに日本に6ヶ月以上滞在している
(Have you already been staying in Japan over 6 months?)
● はい (Yes)
● いいえ (No)

●雇用関係の有無
Presence of employment relationship
現在の所属機関に現在雇用されている
(Are you currently employed by the present affiliated institution?)
● はい (Yes)
● いいえ (No)

●特定類型の談非
Judgment of Specific Categories
経済的利益に基づき、外国政府等の実質的な支配下にある者
(Person substantially under the control of foreign government by economic interests)
● はい (Yes)
● いいえ (No)
上記の他、国内において外国政府等の指示の下で行動する者
(Person acting in Japan under instructions of a foreign government)
● はい (Yes)
● いいえ (No)

●個人情報の取扱い
Handling of personal information
送付いただく個人情報について「本システムのプライバシー保護に関する取り決めについて」をご覧いただき同意してください。
(Please agree after reading "The Rule of Privacy Protection of This System" regarding the handling of personal information.)
■ 以上の内容に同意する (agree with the handling of the privacy information)

次へ(Next)

各項目に情報を入力して、「本システムのプライバシー保護に関する取り決めについて」を確認後「同意する」にチェックを付けます。

次へ→登録

Please agree after reading “The Rule of Privacy Protection of This System” regarding the handling of personal information

agree with the handling of the privacy information.

Next→Submit

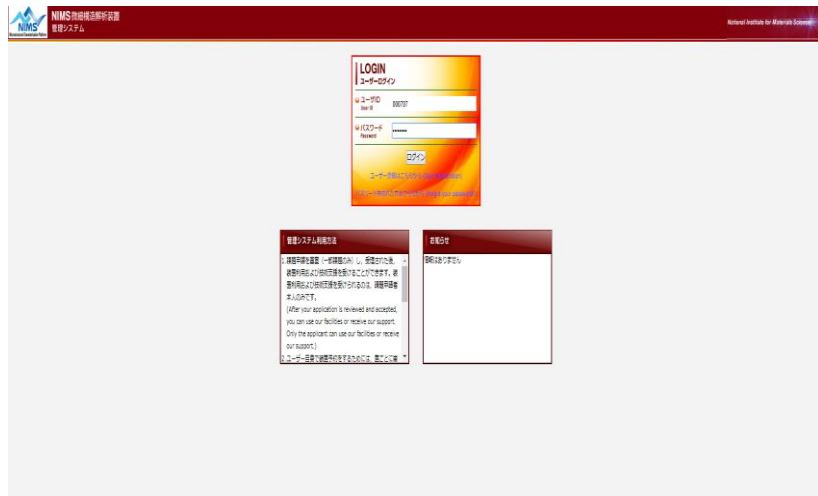
ユーザー登録が完了すると、
本登録のお知らせメールが届きます。
After user registration,
You will get a mail of completion.



【URL】

<https://www.nmcp.jp/>

登録したメールアドレスとパスワードでログインしてください。
Please login with your user email address and password.



ユーザー本登録のお知らせ/Notification of user registration

ユーザー本登録のお知らせ

NIMS 共用装置管理システムよりお知らせいたします。

ユーザー登録の手続きが完了いたしましたので、お知らせいたします。

ユーザーID： *****

ご登録いただいたメールアドレスとパスワードを使用してログインし、「新規利用申請」へ進んでください。

*パスワードはログイン後、ご自身で変更可能です。

NIMS 共用装置管理システムログインページ：<https://www.nmcp.jp/>

装置管理システムの手順(マニュアル)：<https://www.nims.go.jp/nmcp/content/files/shinseitejun.pdf>

This is a message from NIMS microstructural characterization facility services system.

Your user registration has been completed.

User ID: *****

When you receive this registration notice, please log in with your email address and password, you can access "New Application".

You can change the password by yourself after you logged in.

【Registration System URL】<https://www.nmcp.jp/>

Please refer to the link (the manual).

https://www.nims.go.jp/nmcp/eng/content/files/shinseitejun_eng.pdf

【ご注意】

本メールは送信専用となります。このメールへの返信はご遠慮ください。
お問合せは下記までお願いいたします。

[Notice]

Please do not reply to this e-mail.

If you have any inquiries, please contact us below.

利用申請(内部利用)/Application for use

利用申請・支援履歴より新規利用申請を行ってください。
Please apply from “Application for use/Support history” page.

📄 利用申請・支援履歴 - 一覧 Application for use / Support history (List)

2023年度 ▼ 表示する / Show

新規利用申請をクリック
Click 「New application」

新規利用申請 / New application

※利用料金は税抜き表示(not including consumption tax)

2023年度 / 2023FY

コード Code	管理ID Management ID	サイト Site	区分 Type	申請日 Application date	状態 Status	データ共有 Data Share	利用料金 Usage fee	最終利用日 The date of last use	修正 Revised
	支援課題名 A title of application		申請者 Applicant	公開 / 非公開			支援日 The date of support	削除 Deleted	

ユーザ さん

マイページ
My Page

利用申請・支援履歴
Application for use / Support history

装置予約
Equipment reservation

課題別利用料金
Support charge by each subject

ログアウト
Output Registration

利用申請・支援履歴 - 規約の承認 Application for use / Support history (Acceptance of the Terms)

利用規約 General Conditions for Use of Equipment and Facilities	各装置の利用ルールを順守してください。 Please obey the usage rule of each equipment.
注意事項 Notice	年度ごとに利用報告書の提出が義務付けられています。 It is required to submit the usage reports annually.
規約の承認 Acceptance of The Terms	<input type="checkbox"/> 利用規約を承認します。また、報告書の提出に同意します。 I approve the terms and agree to submit the report.
研究不正防止等に係る宣誓 Promise never to do research misconduct	<input type="checkbox"/> NIMSの定める規則、事項を遵守します。 I obey NIMS regulations and terms. <input type="checkbox"/> 研究活動における特定不正行為（捏造、改ざん及び盗用）、及びそれ以外の不正行為（不適切なオーサーシップ、二重投稿等）を行いません。 I will not do any research misconduct (fabrication, falsification, plagiarism, unapt authorship, and duplicate submission).

利用規約に同意し、利用を申し込む / I agree with above provisions, and would like to apply.

利用規約・注意事項の確認と承認をして、「利用規約に同意し、利用を申し込む」をクリック

After confirming the contents and approving, please click “I agree with above provisions, and would like to apply.”.

利用実績に基づく月毎（1ヶ月毎）の請求
Defferend Payment(Pay every month)

※内部課金の支払いルールに基づき、振替申請によりお支払いいただきます。

※Please pay by transfer application (振替申請) based on the payment regulations of the internal charge(内部課金).

支払い方法に同意する / I agree with above.

メッセージを読んで「支払方法に同意する」をクリック
Please read the message and click “I agree with above.”.

申請年度 Application FY	2024
申請者 Applicant	User

申請年度を確認してください。
Please confirm application year, FY20**.

は必須項目 (means "required fields")

研究支援概要 Overview of Research Support

*サイト Site	<input type="text" value="指定なし"/>
*支援課題名 Title of Research-Support Subject	<input type="text"/> 現在の文字数[Current number of characters] 0 ※ 40字以内で記述してください。 * Please input 40 characters or less.
*研究概要 Overview of Your Research	<input type="text"/> 現在の文字数[Current number of characters] 0 250文字以内でお願いします。 Please input 250 characters or less.
*データ共有 Data share	<input type="radio"/> 共有あり(Yes) <input type="radio"/> 共有なし(No)
*NIMS ワークフローシステム課題番号 Applicant ID which was obtained from the NIMS Workflow System	<input type="text" value="24NM****"/>
備考 Note	<input type="text"/>
*主な利用形態 Preferred Style of Use	<input type="text" value="機器利用(Common use)"/> 支援依頼内容[Content of support request] : <input type="text"/> ※技術代行の方は記入してください * For Technical surrogate users

【機器利用・技術補助 Common use/Technical Support】
 サイトを選ぶと装置名が表示されます。利用する装置をすべて選択します。
 Please choose the Site and equipment you use.

【技術代行 Technical Surrogate】
 サイトをお選びください。装置名の選択は不要です。
 Please choose the Site. There are no need to select any equipment.

複数のサイトをご利用の方はサイトごとに利用申請が必要です。
 If you are using multiple sites, an application must be submitted for each site.

NIMSワークフローシステムで取得した**課題番号**を入力してください。
 利用ごとに課題番号を使い分けたい場合は、課題番号ごとに利用申請が必要です。

Please fill in your Application ID obtained from the NIMS Workflow System.
 If you wish to use more than one Application ID , you need to apply for each ID.

* は入力必須項目です。
 * means "required fields"

副ユーザー	
副ユーザー	
利用責任者情報 Supervisor Information	
*利用責任者名 Supervisor Name	<input type="text"/>
*利用責任者Eメールアドレス Supervisor's E-mail Address	<input type="text"/>
特記事項等、その他コメント欄 Special instruction, Other comments	<input type="text"/>

申請者が任期制職員の場合は 定年制職員の入力をお願いします。
また、申請者が定年制職員で、利用について責任が取れる場合はご本人でも構いません。
Please fill in the person who is a Permanent employee.

入力内容を確認する(Confirm)

修正する(Back)

記入が完了したら、「入力内容を確認する(Confirm)」をクリックします。
After completing the entry, click "Confirm".

その後、「上記内容で申請する(Submit)」をクリックします。
And then click "Submit".

申請を受け付けました。
Application has been accepted.

新規利用申請受付のお知らせメールを送信しました。
"Registration of use application" mail has been sent.

[Back to My Page](#)

申請を受け付けしました。
The application has been accepted.

装置の予約/Equipment Reservation

ライセンス所持者のみご自身で機器利用の予約が可能です。
Users have a license can make a reservation on your own.

- ユーザ temuser さん
- マイページ My Page
- 課費申請・文書照会
- 装置予約 Equipment reservation**
- 課費明細書
- 課費発生理由
- ログアウト Output Registration

装置予約 Equipment reservation

前月へ Previous month 2018年 03月 March, 2018 次月へ Next month

予約したい装置もしくは日にちをクリックして下さい (Click the machine name or the date you want to book.)

■ : 本人の予約 (Your booking) □ : 他人の予約 (Others)

装置名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
実動環境対応物理分析電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-G)																															
実動環境対応電子線木ログラフィー電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-B)																															
300kV電界放出形透過電子顕微鏡 (Technai G2 F30)																															
300kV電界放出形電子顕微鏡 (JEM-3000F)																															
200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F1)																															
200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F2)																															
200kV透過電子顕微鏡 (JEM-2100)																															
走査電子顕微鏡 (JSM-7000F)																															
FIB加工装置 (JIB-4000)																															
FIB加工装置 (JEM-9320FIB)																															
FIB加工装置 (JEM-9310FIB1)																															
FIB加工装置 (JEM-9310FIB2)																															
ピックアップシステム (Pick-up System)																															
デュアルビーム加工観察装置 (NBS000)																															
TEM試料作製装置群 (TEM試料作製装置群)																															
ウルトラマイクローム (Ultramicrotome)																															
HRTEM解析システム (HRTEM解析システム)																															
電子線トモグラフィー解析システム (電子線トモグラフィー解析システム)																															
冷却電界放出形ローレンツ電子顕微鏡																															

【予約方法/Reservation Method】
①はじめに、予約したい装置名(または日付)をクリックします。
First, please click an equipment(or date).

※グレーの箇所は他の予約があります。
Gray areas have other reservations.

- ユーザ temuser さん
- マイページ
My Page
- 課題申請・支援履歴
- 装置予約
Equipment reservation**
- 課題別利用料金
Support charge by each subject
- ログアウト
Output Registration

装置予約 - 装置詳細 Equipment reservation (Equipment Details)

200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F2)											
前月へ Previous month				2018年 03月 March, 2018				次月へ Next month			

日付をクリックして予約してください。(Click a date and make a reservation.)

■ : 本人の予約 (Your booking) ■ : 他人の予約 (Others)

		09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	木												
2	金												
3	土												
4	日												
5	月												
6	火												
7	水												
8	木												
9	金												
10	土												
11	日												
12	月												
13	火												
14	水												
15	木												
16	金												
17	土												
18	日												
19	月												
20	火												
21	水												
22	木												
23	金												
24	土												
25	日												
26	月												
27	火												

②次に、予約したい日付(または装置)をクリックします。
Next, please click a date (or equipment).

※グレーになっている箇所は一部でも重複があると予約できません
黄色のラインは本日を意味します。

Gray cell has already been reserved. You can not make a reservation at the same time.
Yellow line shows today.

- ユーザ temuser さん
- マイページ My Page
- 課題申請・支援履歴
- 装置予約 Equipment reservation**
- 課題別利用料申込 Support charge by each subject
- ログアウト Output Registration

装置予約 - 新規登録 Equipment reservation (New Registration)

③利用時間を選択します。
Choose AM or PM or input the time

予約日 Day	2018-03-14		
開始時間～終了時間 Start ~ End	<input type="radio"/> AM <input type="radio"/> PM	09:00 ~ 10:00	※装置により、セッション制もしくは時間単位で表示されます。
装置名 Equipment	200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F2) ※Depending on the equipment, it is displayed either on a session or an hourly basis.		
予約者 Subscriber	temuser		
利用者 User	temuser		
課題 Subject	課題を選択してください		
利用形態 Use Style	機器利用		
コメント Comments			

④課題を選択します。
Choose a subject

⑤入力が完了したらこちらをクリック
Click here

入力内容を確認する / Confirm

戻る / Back

【補足事項/Supplemental remarks】

- * AM & PMで利用したい場合、両方にチェックを入れてください。
If you'd like to reserve both AM and PM, you need to check both.
- * 必要に応じてコメント欄を活用ください。
Please use Comments if necessary.

- ユーザ temuser さん
- マイページ My Page
- 課題申請・支援履歴
- 装置予約 Equipment reservation**
- 課題別利用料金 Support charge by each subject
- ログアウト Output Registration

装置予約 - 新規登録 Equipment reservation (New Registration)

予約日 Day	2018-03-14
開始時間～終了時間 Start ~ End	09:00 ~ 12:30
装置名 Equipment	200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F2)
予約者 Subscriber	temuser
利用者 User	temuser
課題 Subject	[ID-TEM-test1] 例) * * * * * の観察
利用形態 Use Style	機器利用
コメント Comments	

利用予定日の前日からキャンセルできませんので、ご注意ください。
Please note that you will be not able to cancel the reservation from the day before the scheduled date of use.

内容を確認後、
予約を確定します。
After confirmation,
finalize your reservation.

上記の内容で予約する / Set

戻る / Back



- ユーザ temuser さん
- マイページ My Page
- 課題申請・支援履歴
- 装置予約 Equipment reservation**
- 課題別利用料金 Support charge by each subject
- ログアウト Output Registration

装置予約 - 新規登録 Equipment reservation (New Registration)

登録しました / Completed

トップへ戻る / Back to Top Page

予約の修正・取消/Revision & Cancellation

ユーザ temuser さん

マイページ My Page

課題申請・支援履歴

装置予約 Equipment reservation

各装置の稼働料
Support charge by each subject

ログアウト Output Registration

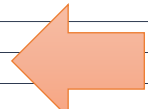
装置予約 Equipment reservation

前月へ Previous month 2018年 04月 April, 2018 次月へ Next month

予約したい装置もしくは日にちをクリックして下さい (Click the machine name or the date you want to book.)

■ : 本人の予約 (Your booking) ■ : 他人の予約 (Others)

装置名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
実験環境対応物理分析電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-G)																														
実験環境対応電子線木ログラフィー電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-B)																														
300kV電界放出形透過電子顕微鏡 (Tecnai G2 F30)																														
300kV電界放出形電子顕微鏡 (JEM-3000F)																														
200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F1)																														
200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F2)																														
200kV透過電子顕微鏡 (JEM-2100)																														
走査電子顕微鏡 (JSM-7000F)																														
FIB加工装置 (JIB-4000)																														
FIB加工装置 (JEM-9320FIB)																														
装置名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
FIB加工装置 (JEM-9310FIB1)																														
FIB加工装置 (JEM-9310FIB2)																														
ピックアップシステム (Pick-up System)																														
デュアルビーム加工観察装置 (NB5000)																														
ウルトラマイクローム (Ultramicrotome)																														
HRTEM解析システム (HRTEM解析システム)																														
電子線トモグラフィー解析システム (電子線トモグラフィー解析システム)																														
イオンスライサー Ion Slicer (TEM試料作製装置群)																														
超深イオン研磨装置③ PIPS(Model 691) 103																														



- ①修正・取り消したい装置をクリックします。
Click an equipment which you would like to revise or cancel.

ユーザ

マイページ
My Page

利用申請・支援履歴
Application for use / Support history

**装置予約
Equipment reservation**

装置別利用料
Support charge by each subject

ログアウト
Output Registration

前月へ Previous month

2022年 06月 June, 2022

次月へ Next month

日付をクリックして予約をしてください。(Click a date and make a reservation.)

■ : 本人の予約 (Your booking) ■ : 他人の予約 (Others)

		09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	水												
2	木												
3	金												
4	土												
5	日												
6	月												
7	火												
8	水												
9	木												
10	金												
		09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	土												
12	日												
13	月												
14	火												
15	水												
16	木												
17	金												
18	土												
19	日												
20	月												
		09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	火												
22	水												
23	木												
24	金												
25	土												
26	日												
27	月												
28	火												
29	水												
30	木												

②修正・取り消したい予約にカーソルを合わせてクリック。
Click the reservation you would like to revise or cancel.



装置予約状況ページへ戻る (Back to the booking status page.)

ユーザ temuser さん

マイページ
My Page

課題申請・支援履歴

**装置予約
Equipment reservation**

課題別利用料金
Support charge by each subject

ログアウト
Output Registration

装置予約 - 詳細 Equipment reservation (Details)

予約日 Day	2018-05-16
開始時間～終了時間 Start ~ End	13:00 ~ 16:30
装置名 Equipment	200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F1)
予約者 Subscriber	temuser
利用者 User	temuser
課題 Subject	[] test課題
利用形態 Use Style	機器利用
コメント Comments	

利用予定日の前日からキャンセルできませんので、ご注意ください。
Please note that you will be not able to cancel the reservation from the day before the scheduled date of use.

予約を修正する / Booking Change



Revise

予約を削除する / Booking Delete



Cancel

戻る / Back

③内容に間違いがないかを確認し、クリック。
Confirm all the contents and click "Revise" or "Cancel".

ユーザ temuser さん

- マイページ
My Page
- 課題申請・支援履歴
Subject application / Support history
- 装置予約
Equipment reservation**
- 課題別利用料金
Support charge by each subject
- ログアウト
Output Registration

装置予約 - 削除 Equipment reservation (Deletion)

装置名 (Equipment) : 【200kV電界放出形透過電子顕微鏡/JEM-2100F1】
予約時間 (Booking Time) : 【13:00~16:30】
を本当に削除しますか？

予約を削除する / Booking Delete

戻る / Back



ユーザ temuser さん

- マイページ
My Page
- 課題申請・支援履歴
Subject application / Support history
- 装置予約
Equipment reservation**
- 課題別利用料金
Support charge by each subject
- ログアウト
Output Registration

装置予約 - 削除 Equipment reservation (Deletion)

削除しました

戻る

この画面になれば作業は完了です。
This page means "Completed".

注: 予約者本人によるキャンセル・変更は予約日の前日まで可能です。(※)

予約日当日のキャンセル・変更は各サイトスタッフと電子顕微鏡ユニット事務局(tem@nims.go.jp)にご連絡をお願いいたします。

使用開始時間の24時間前までのキャンセルは課金されませんが、それ以降のキャンセルは課金される場合がありますのでご了承ください。

※予約前日までキャンセル可能ではありますが、装置の利用効率化のため、予定が分かり次第、早めにキャンセルくださいますようご協力をお願いいたします。

Note: Users can cancel or reschedule their reservations up to one day prior to the reservation date. (※)

Please contact the person in charge and Electron Microscopy Unit office(tem@nims.go.jp) for cancellations or changes on the day of your reservation.

Cancellations made up to 24 hours prior to the start of use will not be charged, but cancellations made after that time may be charged.

※Although it is possible to cancel up to the day before the reservation, we ask for your cooperation in canceling as soon as you know your plans in order to make efficient use of the equipment.

利用料金について

The Support Charge

NIMS 微細構造解析装置 管理システム National Institute for Materials Science

ユーザー

- マイページ My Page
- 利用申請・支援履歴 Application for use / Support history
- 装置予約 Equipment reservation
- 課題別利用料金 Support charge by each subject
- 出力登録 Output Registration

課題別利用料金 Support charge by each subject

2022年度 ▼ 表示する / Show

2022年度 課題別利用料金一覧 [2022-06-15 現在] Total Usage Fees

コード Code	管理ID ▲ Management ID		支援課題名 A title of subject						申請者 Applicant			データ共有	
	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	1月 January	2月 February	3月 March	合計 Total
1817	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	なし ¥0
1905	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	なし ¥0

印刷 (Print) buttons are shown in the grid cells.

2017年度3月 電子顕微鏡入館ランジョン 利用明細書

項目	利用種別	利用期間	利用回数	利用時間	単価	金額	備考
NOF利用	内部利用	2017/03/01~2017/03/01	1	00:05:00	1,500円	1,500円	
請求金額						1,500円	

※NOF利用、内部利用「JEM-2800」、「JEM-ARM300F アドバンス利用」の料金計算には対応していません。

このページで月ごとおよび年度合計の利用料金を見ることが出来ます。「印刷」をクリックすると利用明細書が表示されます。

※NOF利用、内部利用「JEM-2800」、「JEM-ARM300F アドバンス利用」の料金計算には対応していません。

You can see the your monthly and yearly total charges on this page. If you click the print button, you can view the statement.

※Fee calculations for NOF use and internal use 「JEM-2800」 and 「JEM-ARM300F Advance use」 are not supported.